Please type a plus sign side this box > 4

PTO/SB/21 (6-98) Approved for use through 09/30/2000, OMB 0651-0031

| Under the Paperwork Reduct valid OMB control number.   | on Act of 1995, no perso  |   | ce: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE collection of information unless it displays a |
|--|---|---|--|
|  |   | Application Number                        | 10/075,797   |
| TRANSMITTAL  |   | Filing Date                               | February 12, 2002  |
| FORM   |   | First Named Inventor                      | Franz Sorg   |
| (to be used for all correspondence after initial filing)   |   | Group Art Unit                            | Unk.   |
|  |   | Examiner Name                             | Unknown  |
| Total Number of Pages in This Submission   |   | Attorney Docket Numbe                     | r LO29-003   |
| ENCLOSURES (check all that apply)  |   |   |  |
| Fee Transmittal Form   |   | nent Papers<br>Application)               | After Allowance Communication to Group   |
| Fee Attached   |   |   | Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences                     |
| Amendment / Response Licensin  |   | g-related Papers                          | Appeal Communication to Group  (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)             |
| After Final  | After Final Petition Routing Slip (PTO/SB/69) and Accompanying Petition |   | Proprietary Information  |
| ,  |   | to Convert to a nal Application           | Status Letter  |
|  |   | of Attorney, Revocation of Correspondence | Additional Enclosure(s) (please identify below):                               |
| <u> </u>   |   | I Disclaimer                              | PTO Return Postcard<br>Receipt; and certified copy                             |
|  |   | ntity Statement                           | of German Patent Application   |
| Request  |   | t for Refund                              | No. 101 06 605.8.  |
| Document(s) Remarks  |   | -4  | No fee is due, however, the  |
| Incomplete Application   | overpayment to Deposit No. 23-0925.                                     |   |  |
| Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53  |   |   | 00 % -8<br>FOET  |
| SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT   |   |   |  |
| Firm or  |   |   |  |
| or Individual name D. Brent Kenady Reg. No. 40,045; Wells St. John P.S.  |   |   |  |
| Signature De Ven   |   |   |  |
| Date 3-18-02   |   |   |  |
| CERTIFICATE OF MAILING   |   |   |  |
| I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231 on this date: |   |   |  |
| Typed or printed name Cornie b. Kathman  |   |   |  |
| Signature Cliff  | W X NOUT  | Male Date                                 | 63-18-02   |

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the abount of time you are fequired to complete this form should be send to the Chief Information Officer Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

### HE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

| Application Serial No   |
|---|
| Filing Date February 12, 2002                                   |
| Inventor Franz Sorg et al.                                      |
| Assignee Carl-Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies AG |
| Group Art Unit Unassigned                                       |
| Examiner Unassigned   |
| Attorney's Docket No LO29-003                                   |
| Title: System for Damping Oscillators                           |

### **CLAIM FOR PRIORITY**

TO 2800 TALL POT

To:

Assistant Commissioner for Patents

Washington, D.C. 20231

From:

D. Brent Kenady

(Tel. 509-624-4276; Fax 509-838-3424)

Wells, St. John P.S.

601 W. First Avenue, Suite 1300

Spokane, WA 99201-3828

Customer No. 021567

Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. §119, applicant hereby claims the benefit of the filing date of applicant's corresponding German Patent Application Number 101 06 605.8, filed on 13 February, 2001 (13.02.01). This German Patent Application is referred to in applicant's Declaration.

A certified copy of the originally filed German Patent Application is enclosed. Acknowledgment of receipt of this priority document is respectfully

requested.

Respectfully submitted,

Dated: 3-18-02

D. Brent Kenady Reg. No. 40,045

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND





## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

101 06 605.8

Anmeldetag:

13. Februar 2001

Anmelder/Inhaber:

Carl Zeiss, Heidenheim an der

Brenz/DE

Bezeichnung:

System zur Beseitigung oder wenigstens

Dämpfung von Schwingungen

IPC:

G 02 B 27/64

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 10. Januar 2002 **Deutsches Patent- und Markenamt Der Präsident** 

Im Auftrag

Joost

Beschreibung:

01014P

System zur Beseitigung oder wenigstens Dämpfung von Schwingungen

5

Die Erfindung betrifft ein System zur Beseitigung oder wenigstens Dämpfung von Schwingungen in bzw. durch fluidführende Kanäle eines Bauteiles, insbesondere durch Kühlmittel in Kühlkanälen eines optischen Elementes, insbesondere einem Projektionsobjektiv für die Halbleiter-Lithographie.

Aufgrund der Strahlungsenergie, insbesondere in der Halbleiter-Lithographie mit Lasern, die im UV-Bereich Strahlen abgeben, müssen optische Elemente häufig gekühlt werden. Dies gilt z.B. für Spiegel in EUV-Systemen, die in ihrem Gehäuse mit Kühlkanälen versehen sind, durch die eine Kühlflüssigkeit strömt. Auf diese Weise wird eine Wärmeabfuhr erreicht. Problematisch ist es jedoch, daß durch das strömende Medium Schwingungen bzw. Eigenfrequenzen durch eventuelle Turbulenzen, wie z.B. im Bereich von Kanalumlenkungen, auftreten können, welche sich sehr nachteilig auf die gesamte Optik bezüglich deren optischen Funktion auswirken.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein System zur Beseitigung oder wenigstens Dämpfung von Schwingungen in bzw. durch fluidführende Kanäle derart zu erreichen, daß sich keine negativen Auswirkungen durch das strömende Medium ergeben.

30 Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 genannten Merkmale gelöst.

Erfindungsgemäß werden nun piezoelektrische Aktuatoren in Form von dünnen Platten, Folien oder Schichten in Verbindung mit einem adaptronischen Regelkreis, in welchem Sensoren die Schwingungen detektieren und über eine Recheneinheit zur Auswertung den piezoelektrischen Aktuatoren mitgeteilt werden, so daß diese entsprechend aktiviert werden und die durch die Tur-

bulenzen erzeugten Schwingungen bzw. Eigenfrequenzen entgegengesetzt wirkende Schwingungen bzw. Frequenzen erzeugen können.

Erfindungsgemäß sind hierzu sowohl die piezoelektrischen Aktuatoren als auch die Sensoren in dem Bauteil integriert.

Grundsätzlich lassen sich zur Detektion der auftretenden Schwingungen die verschiedensten Arten von Sensoren verwenden. In einer sehr vorteilhaften Ausbildung der Erfindung werden für diesen Zweck jedoch ebenfalls piezoelektrische Sensoren verwendet, welche man in vorteilhafter Weise abwechselnd im Bereich der Turbulenzzonen, wie z.B. Kanalumlenkungen, anordnet.

Zwar ist grundsätzlich die Verwendung von piezoelektrischen

Elementen, wie z.B. Piezostacks, in der Optik aus der US
4,202,605 und der US 4,295,710 bereits bekannt, wobei Piezostacks zur Einstellung von Facettenspiegeln verwendet werden, aber deren Einsatz in Form von Platten, Folien oder Schichten in einem adaptronischen Regelkreis mit Sensoren und Aktuatoren ist neu und stellt eine nicht naheliegende Lösung dar.

Nachfolgend ist anhand der Zeichnung prinzipmäßig ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben.

25 Es zeigt:

35

- Figur 1 ausschnittsweise einen Spiegel mit einem Kühlkanal im Eckenbereich; und
- 30 Figur 2 ausschnittsweise eine Kühlschlange bzw. ein Kühlrohr.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines Spiegels in einem EUV-System mit einem Projektionsobjektiv für die Halbleiter-Lithographie beschrieben. Selbstverständlich ist die Erfindung jedoch auch auf anderen Gebieten der Optik und auch in anderen Bereichen verwendbar.

Durch die EUV-Strahlung von einer Strahlquelle kommt es zu Erwärmungen in dem Spiegel. Aus diesem Grund ist es bekannt, Spiegel 1, die z.B. in einem Projektionsobjektiv 1a (nur gestrichelt angedeutet) angeordnet sind, mit Kühlkanälen 2 zu versehen, in denen ein Kühlmedium zirkuliert. Auch wenn man versucht, das Kühlmedium in einer laminaren Strömung zirkulieren zu lassen, kann nicht immer vermieden werden, daß es zu Turbulenzen kommt. Dies ist insbesondere der Fall im Bereich von Kanalumlenkungen 3. In der Figur 1 ist eingangsseitig eine laminare Strömung und im Umlenkungsbereich eine turbulente Strömung 4 angedeutet, an die sich wieder eine laminare Strömung anschließen kann. Durch die turbulente Strömung 4 kommt es zu Schwingungen des Spiegels 1, womit Änderungen der optischen Pfadlänge auftreten, was zu entsprechenden Bildfehlern führen kann. Dies bedeutet, zur Vermeidung derartiger Bildfehler ist es notwendig, die auftretenden Schwingungen zu vermeiden oder diesen wenigstens in erheblichem Umfange entgegenzuwirken. Hierzu wird man die Gegenmaßnahmen in den Bereichen vornehmen, in denen die größten Verformungen durch Schwingungen vorkommen.

10

20

25

30

35

Hierzu ist es in einem ersten Schritt erforderlich, die Schwingungen zu detektieren. Hierzu dienen Sensoren in Form von piezoelektrischen Elementen 5, die in dem Spiegel 1 im Bereich der Umlenkung 3 angeordnet bzw. integriert sind. Durch die Schwingungen kommt es in den piezoelektrischen Elementen aufgrund von Längenänderungen zur Erzeugung von elektrischen Spannungen, die über Steuerleitungen 6 (in der Figur 2 beispielsweise nur eine dargestellt) einer Rechen- und Auswerteeinheit 7 zugeleitet werden. Entsprechend der Größe und Form der Schwingungen werden über die Rechen- und Auswerteeinheit 7 über Steuerleitungen 8 Spannungsimpulse zu Aktuatoren 9 in Form von piezoelektrischen Elementen zugeleitet. Bei Spannungsauferlegung kommt es in den piezoelektrischen Elementen als Aktuatoren 9 zu Längenänderungen. Wesentlich ist nun, daß die über die Steuerleitung 8 eingebrachten Impulse die piezoelektrischen Elemente 9 derart angeregt werden, daß "Gegenschwingungen" auftreten, welche aufgrund ihrer Größe und Form die durch die turbulente Strömung auftretenden Schwingungen kompensieren oder wenigstens erheblich dämpfen.

5

Die piezoelektrischen Elemente als Sensoren 5 und als Aktuatoren 9 können in dem Spiegel 1 abwechselnd angeordnet sein.

Die Anordnung der piezoelektrischen Elemente 5 und 9 richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten. So können sie z.B. außenseitig an den Kühlkanälen 2 in dem Spiegel 1 angeordnet oder auch in dem Kühlkanal 2 selbst, wie es z.B. in der Figur 1 gestrichelt mit 9' angedeutet ist. Ebenso können die piezoelektrischen Elemente 5 und 9 auch direkt auf eine Kühlschlange 10 außen- oder innenseitig aufgeklebt sein.

Die piezoelektrischen Elemente werden in die Struktur bzw. den Spiegel 1 in Form von sehr dünnwandigen Platten, Folien oder Schichten aufgebracht bzw. eingebracht.

Es kann auch vorgesehen sein, daß alle piezoelektrischen Elemente 5, 9 im Ruhezustand oder in einer Phase mit nur einer geringen Schwingungserregung als Sensoren 5 konfiguriert sind. Auf diese Weise werden Störungen von allen Elementen aufgenommen, wonach durch eine entsprechende Regelung nur einzelne, bestimmte oder im Bedarfsfall auch alle piezoelektrischen Elemente dann als Aktuatoren 9 aktiviert werden. Der Vorteil dieser Ausgestaltung ist, daß dann nicht bestimmte piezoelektrische Elemente als Sensoren oder als Aktuatoren ausgewiesen sein müssen.

#### Patentansprüche:

20

25

30

- 1. System zur Beseitigung oder wenigstens Dämpfung von Schwingungen in bzw. durch fluidführende Kanäle (2) eines Bauteiles, insbesondere von Kühlmittel in Kühlkanälen eines optischen Elementes (1), insbesondere einem Projektionsobjektiv für die Halbleiter-Lithographie, wobei durch Sensoren (5) auftretende Schwingungen detektiert werden, wonach das Ergebnis in Form eines adaptronischen Regelkreises in das optische Element integrierten piezoelektrischen Elementen (9) in Form von dünnen Platten, Folien oder Schichten zugeleitet wird, welche durch deren Aktivierung den durch die Turbulenzen erzeugten Schwingungen bzw. Eigenfrequenzen entgegengesetzt wirkende Schwingungen bzw. Frequenzen erzeugen.
  - 2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die piezoelektrischen Elemente als Aktuatoren (9) und die Sensoren (5) im Bereich von Turbulenzzonen (4) an oder in dem Bauteil (1) angeordnet sind.
  - 3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die piezoelektrischen Elemente als Aktuatoren (9) und Sensoren (5) im Bereich der größten zu erwartenden Verformung angeordnet sind.
  - 4. System nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensoren (5) und die piezoelektrischen Elemente als Aktuatoren (9) im Bereich von Kanalumlenkungen (3) angeordnet sind.
  - 5. System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensoren (5) als piezoelektrische Elemente ausgebildet sind.
- 35 6. System nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Bauteil (1) abwechselnd piezoelektrische Elemente als Sensoren (5) und als Aktuatoren (9) angeordnet sind.

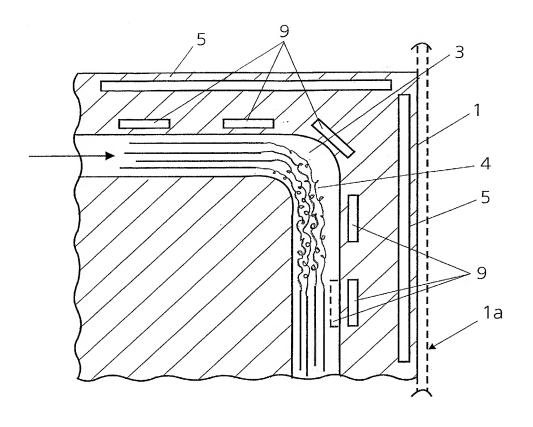
7. System nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß alle piezoelektrischen Elemente (5,9) im Ruhezustand oder bei geringer Schwingungserregung als Sensoren (5) ausgebildet sind, und in Abhängigkeit von einer Schwingungserregung ausgewählte Sensoren (5) als Aktuatoren (9) aktiviert werden.

#### Zusammenfassung:

# System zur Beseitigung oder wenigstens Dämpfung von Schwingungen

5 (Fig. 1)

Bei einem System zur Beseitigung oder wenigstens Dämpfung von Schwingungen in bzw. durch fluidführende Kanäle (9) eines Bauteiles, insbesondere von Kühlmittel in Kühlkanälen eines optischen Elementes (1), insbesondere einem Projektionsobjektiv (1a) für die Halbleiter-Lithographie, werden durch Sensoren (5) auftretende Schwingungen detektiert und ausgewertet, wonach das Ergebnis in Form eines adaptronischen Regelkreises in das optische Element integrierten piezoelektrischen Elementen (9) in Form von dünnen Platten, Folien oder Schichten zugeleitet wird, welche durch deren Aktivierung den durch die Turbulenzen erzeugten Schwingungen bzw. Eigenfrequenzen entgegengesetzt wirkende Schwingungen bzw. Frequenzen erzeugen.



<u>Fig.1</u>

